

концы образца замкнуты, то в цепи возникает ток j_x , если разомкнуты, то — фотоэдс (см. Фотогальванический эффект).

В слабых магн. полях эдс Ф. з. пропорциональна магн. полю H и меняет знак при изменении направления H на противоположное (нечётный Ф. з.). Открыт И. К. Кикоиным и М. М. Носковым в 1933.

В слабых магн. полях ($\mu H/c \ll 1$, где μ — подвижность носителей заряда) плотность тока

$$j_x = -eD \frac{H}{c} (\mu_s + \mu_d) \frac{dn}{dy}$$

Здесь D — коэф. амбиполярной диффузии носителей заряда, n — концентрация неравновесных носителей заряда. Вид распределения n в общем случае сложен; он зависит от диффузионно-рекомбинационных параметров полупроводника, от коэф. поглощения света и квантового выхода фотогенерации носителей.

Неоднородность плотности тока приводит на некоротком образце к циркуляции тока ($\text{rot } j \neq 0$): ток вблизи освещаемой поверхности течёт в одну сторону, а в глубине — в противоположную сторону. В образце с разомкнутыми контактами полный ток, протекающий через всё сечение, равен 0. Наличие замкнутого циркулирующего тока в полупроводнике было доказано экспериментально: насыженный на остриё иглы цилиндрич. образец из Ge при освещении в магн. поле не прерывно вращался вокруг оси (рис. 2).

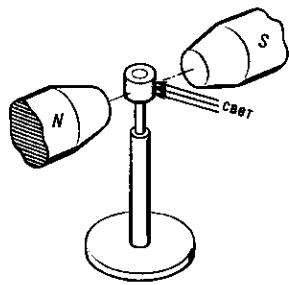


Рис. 2.

В результате действия магн. поля на замкнутый циркулирующий ток в образце, когда направления H и диффузионного потока избыточных носителей при освещении образца не перпендикулярны друг другу, в направлении проекции H на плоскость образца ($b\bar{b}$, рис. 3) возникает фотоэдс, не меняющая знака при изменении направления H на противоположное (чётный эффект, Кикоин, 1934). В поликристаллич. образцах эдс чётного эффекта

$$U \propto \mu H^2 \sin 2\theta,$$

где θ — угол между диффузионным потоком носителей и H .

В монокристаллич. полупроводниках и чётный, и нечётный эффекты анизотропны — величина и знак эдс зависят от взаимной ориентации кристаллографич. осей и H . Т. к. анизотропия связана с анизотропией коэф. диффузии D носителей в присутствии магн. поля, то её исследование позволяет определить эф. массы электронов и дырок вдоль разл. кристаллографич. осей образца.

При темп-рах $T \leq 20$ К из-за разогрева носителей падающим излучением помимо обычного Ф. з., обусловленного градиентом концентрации избыточных носителей, в образце возникает эдс, связанная с градиентом степени разогрева (фототермомагн. эффект).

На основе Ф. з. созданы простые и надёжные методы определения таких параметров полупроводников, как время жизни неравновесных носителей заряда, диффузионная длина, скорость поверхностной рекомбинации, а также детекторы излучения и магнитометры.

Лит.: Кикоин И. К., Лазарев С. Д., Фотоэлектромагнитный эффект, «УФН», 1978, т. 124, в. 4, с. 597. С. Д. Лазарев.

ФОТОМЕТР (от греч. phōs, род. падеж phōtós — свет и metrēō — измеряю) — прибор для измерения к.-л. из фотометрических величин, чаще других — одной или неск. световых величин. Ф. определённым образом пространственно выделяет поток излучения и регистрирует его приёмником с заданной спектральной чувствительностью. Оптич. блок Ф., иногда называемый фотометрич. головкой, содержит линзы, светорассеивающие пластиинки, ослабители, светофильтры, диафрагмы и приёмник излучения. Визуальный Ф. равенство яркостей двух полей сравнения, освещаемых по отдельности сравниваемыми потоками излучения, устанавливается глазом. Ф. с физ. приёмниками, преобразующими поток излучения в электрич. сигнал, включают в себя электронные регистрирующие устройства типа гальванометра, микроамперметра, вольтметра. В импульсных Ф. применяются цифровая вычислительная техника и регистрирующие устройства типа запоминающего осциллографа, пикового вольтметра.

Оптич. схемы Ф. (рис.) для измерения размерных фотометрич. величин обеспечивают постоянство или изменение

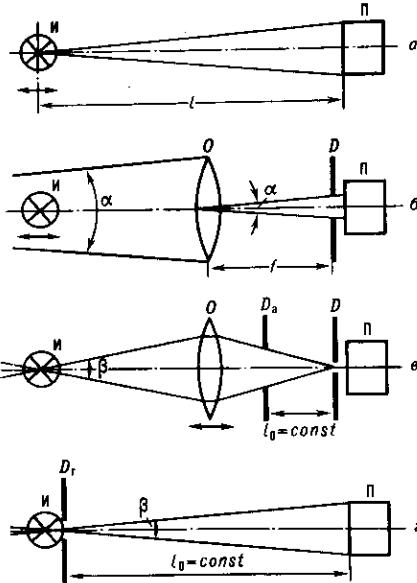


Рис. Принципиальные оптические схемы фотометров для измерения: а — освещённости и экспозиции, а также, с привлечением закона квадратов расстояний, силы света и освещения; б — силы света и освещения телесентрическим методом; в — яркости и интеграла импульса яркости с применением фокусирующей оптической системы; г — яркости с применением габаритной диафрагмы. И — источник света; П — приёмник излучения с исправляющими его спектральную чувствительность светофильтрами и ослабителями; О — объектив, имеющий фокусное расстояние f ; D — диафрагма, устанавливаемая в фокальной плоскости (б) или в плоскости изображения источника (в); D_a — апертурная диафрагма; D_r — габаритная диафрагма; α и β — угловые размеры фотометрируемых пучков лучей.

по определ. закону геометрического фактора. Зависимости фотометрич. величин от направления определяют на гониофотометрах. Измерение общего светового потока или потока излучения, распространяющегося от источника по всевозможным направлениям, осуществляется интегрирующим (шаровым) Ф., осн. часть к-рого — фотометрич. шар (шар Ульбрихта) — представляет собой сферич. оболочку диам. до 5 м с неселективно и диффузно отражающей (белой) внутр. поверхностью. Исследуемый источник помещается внутри шара и отделяется экраном от встроенного в поверхность шара приёмника излучения. Можно также фотометрируемый пучок излучения вводить в шар через небольшое (относительно его диаметра) отверстие в оболочке. Освещённость любого участка внутр. поверх-